

高真空蒸着装置 ED-1700



高真空蒸着装置ED-1700は電子銃(JEOL製EBG-102UB4S)による金属・有機物・誘導体を成膜する装置で、ルツボ4点をトリプルソースコントローラにて成膜することが出来る装置です。また基板傾斜機能、膜厚センサーを設けており、排気系はクライオポンプを取付け、短時間にて排気が可能です。オイルフリーを目的としたドライポンプ+クライオポンプ、ターボ分子ポンプの組合せによるクリーンな排気も可能となっています。

高真空蒸着装置ED-1700仕様

- 到達圧力 ×10⁻⁵Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 φ700mm×900mmH SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子銃電源:JST-10F(JEOL製)
電子銃ルツボ:EBG-102UB4S(JEOL製)
ルツボ個数:4個
- 基板形状 4インチ 6枚+6インチ 1枚
- 基板回転 ドーム形状:φ550mm×100mmH×2mm(材質:Al)
磁気シール駆動方式 0~30rpm
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:1600L/min[60Hz]
クライオポンプ:5000L/sec
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 制御系 基板温度監視
- 操作方法 排気系全自動(手動操作も可)/クライオ自動再生機構
- ユーティリティ電気:AC200V三相25KVA
冷却水:40L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
設置寸法:2400mmW×1600mmD×2200mmH